

自动研磨工作站

UNIPOL-1220S

UNIPOL-1220S 型自动研磨工作站集成研磨、抛光与清洗单元，实现从研磨到清洗的全流程自动化。通过触摸屏操作，用户可精确控制研磨参数并一键启动程序，确保样品处理一致性。设备支持自动更换 16 组不同粒度的砂纸和抛光垫，采用机械加压方式（压力上限 30kg），适应金属、陶瓷、岩样及电子器件等材料。研磨盘片通过真空吸附固定，转速可调，配合 3 组蠕动泵进料系统。整机采用钢板烤漆外壳，配备防尘罩及超声清洗功能，避免工序间污染。内置可编程软件系统及多材料数据库，满足重复性实验需求，显著提升制样效率。



产品名称	<ul style="list-style-type: none"> • 自动研磨工作站
产品型号	<ul style="list-style-type: none"> • UNIPOL-1220
特点	<ul style="list-style-type: none"> • 全自动研磨抛光+清洗一次完成，节省人力 • 研磨盘片用真空吸附在下盘，研磨时，研磨盘转速可任意调整 • 研磨抛光过程中可自动更换不同粒度的研磨砂纸和抛光垫，可储存 16 组 • 采用机械加压方式，且压力可调整，根据样品不同材质，任意调整所需压力，最大 30kg • 配备 3 组蠕动泵进磨料，搭配使用，灵活性高 • 整机外壳钢板烤漆，耐用安全性高，并带有防尘罩 • 方便的触控式人机操作界面，具备可编程的软件系统 • 包含多种材料数据库，可满足对金属、陶瓷、岩样、电子器件等材料的重复性和一致性实验 • 通过超声清洗样品，确保下一道工序不会被上一道工序残留物污染
研磨抛光单元 	<ul style="list-style-type: none"> • 上盘直径：Φ 160mm • 上盘转速：20-350rpm • 最大加载压力：30kg • 下研磨盘直径：300mm • 下研磨盘转速：20-378rpm • 下研磨盘采用真空吸附方式 • 防水圈可升降
清洗单元 	<ul style="list-style-type: none"> • 清洗方式：超声波+清水冲洗 • 有水位检测开关 • 有电磁阀切换进水、排水
储料单元 	<ul style="list-style-type: none"> • 通过程序设置自动更换研磨砂纸和抛光垫 • 最大可储存 16 组 Φ 300mm 磨片和抛光片，更换顺序可设定 • 通过真空吸附固定在研磨抛光盘上 • 通过程序可设置研磨/抛光时间和次数 • 采用电动升降进给方式
研磨抛光液配备 	<ul style="list-style-type: none"> • 用蠕动泵驱动滴料系统 • 标配 3 组滴料器，最大选配 6 组滴料器 • 自动检测滴料瓶是否缺液
外形尺寸	<ul style="list-style-type: none"> • 长 x 宽 x 高：1600×1002×1688mm